干涉現象

實驗目的

使用「Borderless Lab365」平台,觀察激光穿過不同的狹縫(包括單縫、雙縫或光柵) 後產生的**干涉和繞射圖形**,並研究 (i) 狹縫之間的間距 d、(ii) 光的波長 λ、及(iii) 狹縫和 屏幕之間的距離 D,對干涉和繞射圖形的影響。

理論

干涉

- 光波遵循**疊加原理**。當兩個波在空間中的特定點相遇時,產生的擾動只是組成擾動的代數(向量)和。
- 對於干涉圖形,根據惠更斯原理,當相干光源以所需距離 d 穿過兩個不同的狹縫時,從兩個狹縫 S1 和 S2 發出的兩個光波可視為兩個具有相同特性(同等幅度、同等相位、同等波長等)的單獨點源等。於此,我們假設兩個狹縫無限小(否則干涉圖形會結合干涉及繞射圖形,如圖三所示)。光波以波浪形式穿過狹縫,相互重疊後於距離 D 的屏幕上呈現(圖一)。
- 當 D >> d (其中 D 為狹縫與屏幕之間的距離, d 為狹縫間距)並發生相長干涉時, 中央極大值與相鄰極大值之間的距離可由 $\Delta y = n \frac{\lambda D}{d}$, n = 0、±1、±2...計算。
- 當相消干涉發生時,中央極大值與相鄰極小值之間的距離可由 $\Delta y = (n + \frac{1}{2})\frac{\lambda D}{a}$, n = 0、±1、±2...計算。







繞射

- 另一方面,光線穿過一個有限大小的單縫a形成繞射圖形(圖二)。此現象可以干 涉現象解釋,但詳細計算於此省略。
- 對於出現第一個極大值,我們將單縫分成兩半。如圖二所示,設一點於上半部和 另一點於下半部的頂。這兩點如楊氏雙縫實驗中的兩個狹縫(狹縫距離為 a/2)。
 為產生相長干涉,程差(r2-r1)需等於一波長。因此,我們在略低於之前兩個點的位 置選取另外兩點(一點於上半部分,另一個於下半部分),這兩個新點應該與前 兩點相似並擁有相同程差。然後,這兩個新點將再次產生建設性的干擾。這樣, 上半部的所有小點都會在下半部有一個對應點,在P點上產生整體相長干涉,作為 第一個極大值的繞射圖形。
- 與干涉相比,其第一個、第二個和其他極大值具有相同的光強度和闊度;反觀繞射圖形的第一個、第二個和其他極大值的光強度和闊度都不同(如圖二所示)。
 而這就是干涉圖形和繞射圖形之間的主要區別。





 在真實的楊氏雙縫實驗(兩個擁有有限狹縫闊度a的狹縫),我們預計可觀察到以 下模式:理想的干涉圖形和繞射圖形的結合。



最終結果:圖三所示,為真實的楊氏雙縫實驗的最終結果。請確保您能夠區分哪一個是干涉圖形的第一個最大值,及哪一個是繞射圖形的最大值!



設置

- 「Borderless Lab365」平台
- 激光光源(紅色 λ=650 nm 或綠色 λ=520 nm)
- 具有不同狹縫設定的可移動軌道。每個狹縫下方均有註明該狹縫的資料。



狹縫(從左到右)	參數
單縫 0.3	狹縫闊度:0.3mm
單縫 0.2	狹縫闊度:0.2mm
單縫 0.1	狹縫闊度:0.1mm
單孔 0.3/0.2	無需使用
雙縫 0.2	狹縫間隔距離:0.2 mm
雙縫 0.25	狹縫間隔距離:0.25 mm
光柵	300 線/cm

• 在移動路軌的光強傳感器



• 「狹縫與傳感器距離」的預設最小值為10公分。

步驟

- 登入「Borderless Lab365」平台,預約後進入「干涉現象」實驗模組 https://labxra.edu.hk/remotelab/platform/#/
- 初始設定:透過滑動或與填入數值改變「狹縫與傳感器的距離」,將狹縫組與屏幕之間的距離設定為100毫米或更大。
- 點選激光光源: 此實驗採用兩種不同波長的激光,於控制面板按「紅」或「綠」啟動相應的激光。 然後透過滑動或填入數值改變「激光強度」調整激光強度(請避免調較激光至最)

大強度,因太光亮的激光光斑會導致難以進行對準)。當激光強度設定為「非零」 **值後**,激光將會啟動。

- 4. 選擇其中一個狹縫(單縫、雙縫或光柵)並把激光光斑與該狹縫對齊: 透過滑動或與填入數值改變「狹縫位置」來調整移動可移動軌道的位置,直至激 光光斑擊中所選狹縫的中間(您可以從「攝像機1」觀察激光位置)。
- 5. 調較各個實驗參數: 透過滑動或與填入數值改變「傳感器水平/垂直位置」、「狹縫與傳感器的距離」 和「量度距離」的數值,調整光強傳感器的位置和圖形。您可透過「攝像機2」當 中,在傳感器附近的屏幕上觀察圖形。(屏幕上的一條橫線是用於輔助校對光強 傳感器的水平位置)

各參數的作用如下:

狹縫位置: 選擇在量度中使用哪個狹縫(或光柵)。

狹縫與傳感器的距離:調整狹縫與光強傳感器之間的距離(通常此參數在步驟2設 **置**,然後固定)。

傳感器水平位置: 調整光強傳感器量度範圍的起始位置。

調整光強傳感器的高度,確保光強傳感器的位置(與輔助 傳感器垂首位置: 線位於相同水平)與干涉/繞射圖形處於相同高度。 設定傳感器量度的範圍。

量度距離:

*您可參考實驗的「裝置照片」了解更多。

- 點選「開始量度」掃描圖形。在自動掃描期間,所有按鈕將被停用。
- 7. 等待掃描結束,按鈕將再次啟用。 同時,圖形數據將以圖表方式顯示在「量度結 果」上。
- 8. 點選圖表右上方的選單按鈕,下載圖表並選擇適當的格式 (.svg, .png, .csv).
- 9. 應用不同的參數重複實驗。 使用 (i) 激光光源、(ii) 狹縫(單縫、雙縫或光柵) 或 (iii) 螢幕距離(D) 的不同數值重 複進行實驗,判斷參數對干涉及繞射圖形的影響。您可以設計自己的實驗,也可 以按照下列「數據」部分所建議的實驗(第1組、第2組和第3組)來操作。
- 10. 為了獲得良好的干涉/繞射圖案,您可以透過緩慢地將「狹縫與傳感器的距離」調 校至更大的數值,將屏幕移離狹縫。結合步驟 10 和步驟 5,把干涉圖形調整至最 光亮及最清晰。
- 11. 將「激光強度」滑動至「0」關閉激光,然後登出您的帳戶。

數據(建議研究)

<u>第1組:雙縫:研究Δy和d之間的關係</u>	
狹縫間隔距離 d =	m(<i>從不同的狹縫中選擇)</i>
螢幕距離 D =	m(<i>固定值</i>)
光的波長λ=	m(<i>固定值</i>)

極大值/極小值	位置(m)
中心極大值	
1 st 極小值	
1 st 極大值	
2 nd 極小值	
2 nd 極大值	
3rd極小值	
3 rd 極大值	

* 如果有良好的對齊效果,您可以觀察第一個、第二個、第三個和第四個極大值。然後您以 n 最多為4 繪畫的圖表(即4 個數據點)。

第2組:雙縫:研究Δy和D之間的關係

狹縫間隔距離 d =	m(<i>固定值</i>)
螢幕距離 D =	m(<i>自定的複選值</i>)
光的波長λ=	m(<i>固定值</i>)

極大值/極小值	位置(m)
中心極大值	
1 st 極小值	
1 st 極大值	
2nd 極小值	
2 nd 極大值	
3 rd 極小值	
3 rd 極大值	

<u>第3組:雙縫:研究Δy與λ之間的關係</u>

狹縫間隔距離 d =	m(<i>固定值</i>)
螢幕距離 D =	m(<i>固定值</i>)
光的波長λ=	m(<i>紅或綠</i>)

極大值/極小值	位置(m)
中心極大值	
1 st 極小值	
1 st 極大值	
2 nd 極小值	
2nd極大值	
3 rd 極小值	
3 rd 極大值	

討論

- 根據第1組數據,繪製 Δy 與 n 的關係圖,其中 n 是極大值的數量(即 n=1、2 和 3)。圖表是一條直線嗎?斜率是多少;與理倫值有什麼差別嗎?如果使用另一個 d 值,圖表會如何改變?
- 根據第 2 組數據,請繪製不同 n=1 時 Δy 與 D 的關係圖。圖表是一條直線嗎?斜 率是多少;與理倫值有什麼差別嗎?如果使用 n=2,圖表會如何改變?
- 3. 根據第3組數據,隨著波長的改變,圖形會有什麼變化?
- **4**. 條紋間距的結果是否與方程式 $\Delta y = \frac{\lambda D}{d}$ 一致?
- 5. 隨著極大值的順序變高,記錄到的光強度有什麼變化?為什麼?
- 6. 實驗中可能出現哪些誤差?
- 描述在以下情況下,屏幕上的干涉圖形將如何改變(包括條紋的位置和強度、相鄰 條紋之間的間隔等)
 - i) 把屏幕移離狹縫。
 - ii) 點光源的單色波長增加。
 - iii) 狹縫間隔距離 d 增加。
 - iv) 使用兩個光源,並強制其他光源穿過其他狹縫。
 - v) 在狹縫 S2 後方加上薄玻璃片。
 - vi) 在每個狹縫後方加上一個理想的線性偏振片,而偏振片的透射軸彼此垂直。
- 8. 當狹縫闊度減少時,繞射圖案會發生什麼變化?
- 使用繞射光柵光譜的第一個極大值,估計繞射光柵每長度的線數。與是否與理論值相同?

©香港理工大學 2024 版權所有。